

<i>Литовченко С.В., Береснев В.М., Дробышевская А.А., Турбин П.В.</i> Силицидные покрытия на молибдене: получение, структура, свойства	110
<i>Братушка С.Н., Соколов С.В.</i> Влияние плазменной обработки и ионной имплантации на свойства и структурно-фазовые изменения в титановых сплавах	138
<i>Васильев В.В., Стрельницкий В.Е.</i> Особенности морфологии поверхностей покрытий, наносимых из фильтрованной вакуумно-дуговой катодной плазмы на ферромагнитные подложки	162
<i>Глазунов Г.П., Пашнев В.К.</i> Способ диагностики состояния поверхности вакуумной камеры торсафона Ураган-2М	173
<i>Погребняк А.Д., Мухаммед А.К.М., Иващенко М.Н., Опанасюк Н.Н., Суджанская И.В.</i> Структурные исследования пленок оксида цинка и нитрида алюминия, полученных методами CVD и магнетронного распыления	177
<i>Сичікова Я.О.</i> Низькорозмірні структури на поверхні фосфіду індію .	183
<i>Ахмадалиев Б.Ж., Полвонов Б.З., Юлдашев Н.Х.</i> Поляритонная люминесценция в кристаллах типа CdTe с учетом затухания экситонов	191
<i>Выжол Ю.А., Козлова Л.Г., Муленко И.А., Хомкин А.Л.</i> Моделирование интенсивности излучения классического гармонического осциллятора в поле случайной силы	200
<i>Морушко О.В., Будзуляк І.М., Сегін М.Я., Остафійчук Б.К., Ільницький Р.В., Яблонь Л.С, Кисляк О.Р.</i> Спектри катодолюмінесценції термічно модифікованого TiO ₂	207
<i>Левенец В.В., Омельник А.П., Щур А.А.</i> Аналитическое представление сечений ионизации К-оболочек лантаноидов ускоренными протонами	211
<i>Кирилаш А.И., Симченко С.В., Кидалов В.В.</i> Фотоэлектрические преобразователи на основе пористого арсенида галлия	217
<i>Гулямов Г., Шарипбаев Н.Ю.</i> Температурная зависимость ширины запрещенной зоны Si и связь с тепловым уширением плотности состояний	221
<i>Каримов А.В., Ёдгорова Д.М., Абдулхаев О.А., Каманов Б.М., Гиясова Ф.А.</i> Фототранзистор составной на полевых транзисторах	226
<i>Абдулхаев О.А., Гиясова Ф.А., Ёдгорова Д.М., Каманов Б.М., Каримов А.В.</i> Функциональные характеристики полевого транзистора с управляющим p-n-переходом при различных режимах включения	230
<i>Правила оформлення рукописей</i>	236
<i>Правила оформлення рукописів</i>	237
<i>Information for authors</i>	238